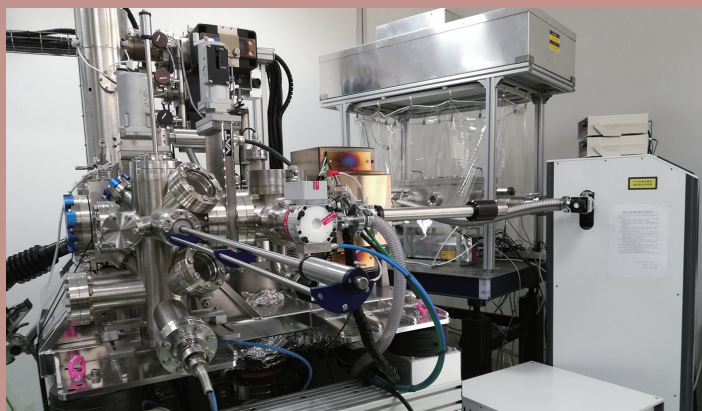


# 深紫外激光光发射电子显微镜

DUV/VUV-DPL Photon Emission Electron Microscope

DUV/VUV-DPL PEEM



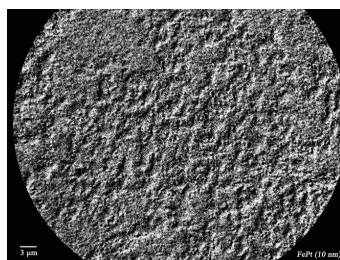
## 性能指标

- 空间分辨率：7 nm
- 能量分辨率：< 0.2 eV
- 激发光源：177.3 nm 全固态激光器（DUV/VUV-DPL）

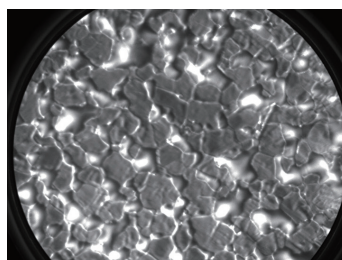
## 主要应用

用于物理、化学、材料学等

## 代表性应用成果



用于 MgO/Pt/FePt 磁性薄膜成像



用于钡钨阴极材料成像

主要用户单位	中国科学院大连化学物理研究所、北京中科科仪股份有限公司、中国科学院物理研究所、中国科学院电子学研究所、中国科学技术大学等
研制单位	中国科学院理化技术研究所、北京中科科仪股份有限公司、中国科学院大连化学物理研究所
联系方式	张申金 010-82543470, 13488671978 zhangshenjin@163.com